⁶Coγ射线辐射对 AlGaN/GaN HEMT 器件的影响*

谷文萍 * 张进城 王 冲 冯 倩 马晓华 郝 跃

(西安电子科技大学微电子学院, 宽禁带半导体材料与器件教育部重点实验室, 西安 710071) (2008 年 4 月 8 日收到 2008 年 8 月 8 日收到修改稿)

采用⁶⁰Coγ射线辐射源对非钝化保护的 AlGaN/GaN 高电子迁移率晶体管(HEMT)器件进行了 1 Mrad(Si)的总剂 量辐射,实验发现辐射累积剂量越大,器件尺寸越小,器件饱和漏电流和跨导下降越明显,同时辐射后器件栅泄漏 电流明显增大,而阈值电压变化很小.对辐射前后器件的沟道串联电阻和阈值电压变化的分析表明,辐射感生表 面态负电荷的产生是造成 AlGaN/GaN HEMT 器件电特性退化的主要原因之一.

关键词:AlGaN/GaN HEMT 器件,γ射线辐射,表面态 PACC:6180E,7280E,7360L,7320

1.引 言

由于 AlGaN/GaN 异质结构材料具有宽禁带、高 击穿场强、高饱和电子漂移速度、高热导率以及可形 成高密度、高迁移率的二维电子气 因此基于该材料 的高电子迁移率晶体管(HEMT 器件)在高温、高频 和大功率电子器件方面极具应用前景 ,受到广泛的 关注和研究^[1-3]. 作为宽禁带半导体 ,GaN 材料原子 键能很强 ,其中 GaN 中 Ga 原子的位移阈能 20.5 eV 要远高于 GaAs 中的 9.8 eV^[4,5],因此 AlGaN/GaN HEMT 器件也具有出色的抗辐射特性. AlGaN/GaN HEMT 器件结合了优越的抗辐射和出色的微波功 率、高温、高压等特性 ,在卫星、太空探测、核反应堆 等辐射环境中具有巨大的应用前景.

然而,虽然理论上 AlGaN/GaN HEMT 器件的抗 辐射特性很强,但是由于受到目前材料质量、器件工 艺水平以及材料与器件结构等因素的影响,AlGaN/ GaN HEMT 器件的抗辐射特性还远远没有体现出 GaN 基材料的优势.同时由于 AlGaN/GaN 异质结构 材料和 HEMT 器件在结构、载流子产生机制和载流 子输运机制等方面与其他半导体器件存在很大的差 异,使得辐射引起 AlGaN/GaN HEMT 器件的退化规 律和退化机制变得非常复杂,需要开展深入研究. 因此近几年 AlGaN/GaN HEMT 器件在 γ 射线、电子、 质子和中子等辐射下的特性退化研究开始得到关 注^[6-8]. 2002 年美国康奈尔大学 Vituserich 等^{9]}研究 了 γ 射线辐射 AlGaN/GaN HEMT 器件性能的影响 , 发现辐射剂量相对较小(10⁵ rad)时器件参数就发生 明显变化 ,所有器件的跨导均减小 ,阈值电压均变 负 . 虽然有关 AlGaN/GaN HEMT 器件的 γ 射线辐射 研究已有报道^[6,9—11] ,但是受 AlGaN/GaN HEMT 器件 结构、材料质量和器件工艺等因素的影响 ,γ 射线辐 射引起的器件退化呈现复杂的现象 ,需要开展更多 的实验研究 ,特别是需要对其辐射退化和损伤机制 进行深入研究.

本文采用平均能量为 1.25 MeV 的⁶⁰Co γ 射线对 非钝化保护的蓝宝石衬底 AlGaN/GaN HEMT 器件进 行辐射试验,测量分析了不同尺寸器件辐射前后的 直流特性,研究了不同剂量γ射线辐射下 AlGaN/ GaN HEMT 器件饱和漏电流、阈值电压、峰值跨导和 栅漏肖特基二极管特性等参数的退化规律,讨论了 其辐射退化的物理机理.

2. 器件制造和辐射实验

采用自主研制的3片2英寸低压立式金属有机物化学气相沉积(MOCVD)设备进行AlGaN/GaN异

† E-mail :wpgu@yahoo.cn

^{*} 国家自然科学基金重点项目(批准号 50736033)和预先研究项目(批准号 51311050112 51308030102 51308040301)资助的课题.

质结构材料生长, 在单面抛光(0001)面蓝宝石衬底 上,首先在 550℃下生长约 30 nm 厚的 AlN 缓冲层, 接着升温至 1040℃生长 1.5 µm 未掺杂 GaN 外延层 和 23 nm 厚 AlGaN 势垒层. AlGaN 势垒层由 6 nm 未 掺杂 AlGaN 层、10 nm Si 掺杂(Si 掺杂浓度约为 2× 10¹⁸ cm⁻³)AlGaN 层和 7 nm 未掺杂 AlGaN 层组成. 所有 AlGaN 层 Al 的摩尔组分均为 30%. 室温霍尔效 应测量显示该异质结构材料方块电阻为 308 Ω/□, 电子迁移率为 1570 cm²/Vs,电子面密度为 1.29 × 10^{13} cm⁻².为了研究非钝化保护的 AlGaN/GaN HEMT 器件的辐射机理 HEMT 器件制造工艺由台面 刻蚀隔离、源漏欧姆、栅肖特基接触和加厚电极等步 骤组成. 台面刻蚀隔离采用感应耦合等离子体 (ICP) 干法刻蚀 刻蚀深度约为 150 nm. 器件源漏欧 姆接触采用电子束蒸发 Ti/Al/Ni/Au (20 nm/120 nm / 55 nm/45 nm) 多层金属,在 830℃下氮气气氛中快速 热退火 30 s. 栅肖特基接触采用电子束蒸发 Ni/Au (20 nm/200 nm)形成. 研究选用的 AlGaN/GaN HEMT 器件均未钝化,有两种栅长0.8 µm 和1 µm,栅宽为 60 μm ,源漏间距为 4 μm ,栅极处于源漏间正中央.

AlGaN/GaN HEMT 器件的辐射实验是在^ωCoγ

射线源上进行的. 辐射时环境温度为室温, γ 射线 平均能量为 1.25 MeV 辐射总剂量为 1 Mrad Si).

采用 HP4156B 精密半导体参数分析仪在室温 下测试辐射实验前后器件的直流特性.辐射完成后 30 分钟内进行器件特性测试.

3. 实验结果与分析

图 1 给出了 AlGaN/GaN HEMT 器件在 1 Mrad ⁶⁰Co γ 射线辐射前后的输出特性和转移特性曲线. 图中 V_d 代表漏压 , I_d 代表漏电流 , g_m 代表跨导 , L_g 和 W_g 分别代表器件的栅长和栅宽 ,以下各图中也 一样.由图 1(a)可以看出 ,低栅压时饱和漏电流退 化很小 栅压为 – 1 , – 2 和 – 3 V 时辐射前后输出特 性几乎没有变化 ,但是栅压较高时(0 V 和 1 V)饱和 漏电流发生了较明显的退化.图 1(b)的转移特性也 呈现相同的规律.由图 1(b)可得辐射后 V_g = 1 V 时 饱和漏电流下降了 15% ,峰值跨导减小了 9.1%.但 是从图 1(b)也可以看出 辐射前后器件阈值电压几 乎没有发生明显变化 ,这与 Luo 等⁶¹得出的辐射后 器件阈值电压变负的结论有所不同.



图 1 1 Mrad ⁶⁰Co γ 射线辐射前后 HEMT 器件的输出特性(a)和转移特性(b) 输出曲线中从上到下栅压(V_g)分别对应 1 V, 0 V, - 1 V, - 2 V, - 3 V

图 2 给出了饱和漏电流的变化量 ΔI_{ds} 和峰值跨 导变化量 Δg_{max} 随辐射剂量的退化规律. 由图 2 可 见 ,累积辐射剂量越大 ,饱和漏电流和峰值跨导退化 量越大 ,而且饱和漏电流的退化量比跨导退化量大. 图 3 给出了1 Mrad ⁶⁰Co γ 射线辐射前后两种不同栅 长 HEMT 器件转移特性的变化. 由图 3 可以看出 , 栅长越小 ,器件参数相对退化越严重. 图 4 给出了 AlGaN/GaN HEMT 器件在 1 Mrad ⁶⁰Coγ射线辐射前后栅漏肖特基二极管正向特性和 反向特性的变化.由图 4 可以看出,辐射后栅正向 电流明显增大,而且栅反向泄漏电流也明显增强,这 与以前报道的γ射线辐射后栅泄漏电流明显减小^[6] 呈现不同的结果.

综上所述 随着γ射线辐射剂量的增大 炮和漏



图 2 ΔI_{ds} 和 Δg_{mmax} 随辐射剂量的退化



图 3 1 Mrad ⁶⁰Co γ 射线辐射前后不同栅长器件转移特性的变化

电流和峰值跨导不断减小,但是阈值电压几乎不变, 而且辐射后栅漏二极管的正向和反向栅电流均 增大.

4. 辐射退化机制分析

Fan 等^[11]已经报道了 300 Mrad ⁶⁰Co γ 射线辐射 对 AlGaN/GaN HEMT 器件 2DEG 输运特性的影响,认 为辐射后的器件退化主要是由于异质结辐射感生界 面态电荷的作用. Luo 等⁶¹也报道了 600 Mrad ⁶⁰Co γ 射线辐射对 AlGaN/GaN HEMT 器件直流特性的影 响 发现即使在 300 Mrad 时器件直流特性退化也很 微弱,认为大辐射剂量(600 Mrad)下,由于辐射引入 了深能级电子陷阱,这些陷阱缺陷的去载流子效应 使得辐射后器件饱和漏电流和跨导峰值下降了 30%左右. 而 Umana-Membreno 等¹⁰通过深能级瞬 态谱(DLTS)的测量发现辐射引入的深能级受主缺 陷是造成器件参数退化的主要原因。根据以上文献 报道,我们可以看出,由于 AlGaN 和 GaN 材料具有 很强的化学键和很高的辐射阈能[4,5],所以通常只 有上百 Mrad 的 γ 射线辐射总剂量才能引起数量较 多的异质结辐射感生界面态和辐射感生深陷阱,使 得 AlGaN/GaN HEMT 器件的特性发生明显退化.

但是本文的研究结果表明,γ射线辐射总剂量 1 Mrad就引起了饱和漏电流和峰值跨导的明显退 化.界面态和陷阱电荷的产生因辐射总剂量很低, 所以产生的量很少,不足以引起器件明显的退化,它 们的影响几乎是可以忽略的.我们认为,本文 1 Mrad辐射实验引起器件特性退化主要归因于表面 态负电荷的增加.在γ射线辐射下,源、漏和栅电极 下方由于金属层的屏蔽效应而几乎没有受到辐射的 影响,但是未钝化的栅源和栅漏间隔区直接暴露在 γ射线辐射下,产生了表面态负电荷,这些表面态负



图 4 1 Mrad ⁶⁰Coγ射线辐射前后 AlGaN/GaN HEMT 器件栅漏二极管正向特性(a)和反向特性(b) 图中 I₂ 是栅电流

58 卷

电荷会对栅源和栅漏间隔区下方的二维电子气造成 一定的耗尽作用,使得总的二维电子气密度(n_s)减小了.

在忽略了载流子扩散的贡献后,利用电流密度 方程可得到沟道中的饱和漏电流为^[12]

$$I_{\rm ds} = \frac{Wq\mu}{L} \int_{V_{\rm th}}^{V_{\rm g}} n_{\rm s} (u) du , \qquad (1)$$

式中,q 是电子电荷,W 是栅宽,L 是栅长, μ 为迁移率, V_a 为栅压, V_h 为阈值电压.

1 Mrad⁶⁰Co γ 射线辐射后,由于表面态负电荷对 栅源和栅漏间隔区下方二维电子气的耗尽作用,总 的二维电子气密度(n_s)减小了,因此辐射后器件饱 和漏电流有所减小.而从跨导的定义也很容易得 出,随着饱和漏电流的减小跨导峰值也降低了,这从 图1的输出和转移曲线上可以明显看出.

但是由于栅电极下方二维电子气密度没有受到 辐射的影响,因此辐射前后阈值电压几乎没有发生 变化.这也与转移曲线所表达的信息一致.而辐射 诱生表面态负电荷使得栅漏间隔区沟道电阻 R_{st}和 栅源间隔区沟道电阻 R_s有所增大,这使得器件漏 源导通电阻增大,从而引起漏源饱和电流下降.由 于栅压较低时(接近阈值电压),漏源导通电阻主要 部分是栅下方沟道电阻,栅漏和栅漏间隔区下方沟 道电阻在整个漏源导通电阻中所占比例较低,因此 辐射诱生间隔区二维电子气退化对器件饱和漏电流 的影响较小,但是当栅压较高时,栅下方沟道电阻较 小 栅漏和栅漏间隔区下方沟道电阻在整个漏源导 通电阻中所占比例较高,因此辐射诱生间隔区二维 电子气退化对器件饱和漏电流的影响较大.这可以 解释图1中低栅压时饱和漏电流退化较小而高栅压 时饱和漏电流退化较大这一现象.

由于栅源和栅漏间隔区表面态负电荷的产生大 大增加了栅漏电极之间的表面漏电,从而使得栅漏 二极管的正向和反向栅电流在辐射后均产生明显增 大.这就解释了图4给出的AlGaN/GaN HEMT 器件 在1 Mrad⁶⁰Coγ射线辐射前后栅漏肖特基二极管正 向特性和反向特性的变化.

图 3 中器件栅长越小 辐射退化量越大,这是因为器件栅长的减小使得栅漏和栅源间隔区面积增 大,受到辐射影响的区域增大,因此辐射感生的表面 态负电荷也越多,从而使得器件参数退化也越大.

5.结 论

上述实验表明,1 Mrad(Si)⁶⁰Coγ射线辐射后, 未钝化的 AlGaN/GaN HEMT 器件的饱和漏电流减小 了 15%,跨导峰值下降了 9.1%,栅泄漏电流明显增 强.而且通过不同剂量(0—1 Mrad)辐射发现,辐射 剂量越大,饱和漏电流和跨导峰值退化越明显.分 析表明,这种低剂量下的明显辐射退化主要是由于 栅漏和栅源间隔区辐射感生表面态负电荷引起的.

- [1] Eastman L F , Tilak V , Smart J , Bruce M G , Eduardo M C , Dimtrov R , Kim H , Ambacher O S , Weimann N , Prunty T , Murphy M , Schaff WJ , Shealy J R 2001 IEEE Trans. Elec. Dev. 48 479
- [2] Wu Y F, Kapolnek D, Ibbetson J P, Parikh P, Keller B P, Mishra U K 2001 IEEE Trans. Elec. Dev. 48 586
- [3] Sheppard S T, Doverspike K D, Pribble W L 1999 IEEE Elec. Dev. Lett. 20 161
- [4] Khanna S M, Webb J, Tang H, Haudayer A J, Carlone C 2000 IEEE Trans. Nucl. Sci. 47 2322
- [5] Look D C , Reynolds D C , Hemsky J W , Sizelove J R , Jones R L , Molnar R J 1997 Phys. Rev. Lett. 79 2273
- [6] Luo B , Johnson J W , Ren F , Allums K K , Abernathy C R , Pearton S J , Dabiran A M , Wowchack A M , Polley C J , Chow P P , Schoenfeld D , Baca A G 2002 Appl. Phys. Lett. 80 604
- [7] Luo B , Johnson J W , Ren F , Allums K K , Abernathy C R , Pearton

S J , Dwivedi R , Fogarty T N ,Wilkins R , Dabiran A M , Wowchack A M , Polley C J , Chow P P , Baca A G 2001 *Appl* . *Phys* . *Lett* . **79** 2196

- [8] Polyakov A Y, Smirnov N B, Govorkov A V, Markov A V, Pearton S J, Kolin N G, Merkurisov D I, Boiko V M 2005 Appl. Phys. Lett. 98 033529
- [9] Vituserich S A, Klein N, Belyaev A E 2002 Mat. Res. Soc. Symp. 719 F5.4.1
- [10] Umana-Membreno G A , Dell J M , Hessler T P , Nener B D , Parish G , Faraone L , Mishra U K 2002 Appl. Phys. Lett. 80 4354
- [11] Fan L, Zhang J C, Li P X, Hao Y 2003 Chin. J. Semiconduct.
 24 937 (in Chinese] 范 隆、张进城、李培咸、郝 跃 2003 半
 导体学报 24 937]
- [12] Rashmi S , Haldar S , Gupta R S 2001 Microwave Opt. Tech. Lett. 29 117

Influence of ⁶⁰Co γ-ray irradiation on AlGaN/GaN high electron mobility transistors *

Gu Wen-Ping[†] Zhang Jin-Cheng Wang Chong Feng Qian Ma Xiao-Hua Hao Yue

(School of Microelectronics , Key Laboratory of Ministry of Education for Wide Band-Gap Semiconductor Materials and Devices , Xidian University , Xi 'an 710071 , China)

(Received 8 April 2008; revised manuscript received 8 August 2008)

Abstract

AlGaN/GaN high electron mobility transistors (HEMT) unpassivated with different gate lengths are irradiated with 60 Co γ rays to doses up to 1 Mrad Si). The bigger the doses are and the smaller the gate lengthis , the greater the changes in drain current and transconductanceare. While the gate leakage current is significantly increased after irradiation , the threshold voltage is relatively unaffected. By analysing the series resistance of channel and the threshold voltage , we find that irradiation induced electronegative surface state charges is one of the important reasons of radiation damage.

Keywords : AlGaN/GaN HEMTs , 60 Co $\gamma\text{-rays}$ irradiation , surface state PACC : 6180E , 7280E , 7360L , 7320

^{*} Project supported by the Key Program of National Natural Science Foundation of China (Grant No. 60736033) and the Advanced Research Foundation of China (Grants Nos. 51311050112 51308030102 51308040301).

[†] E-mail :wpgu@yahoo.cn